

# Machine À Four Tubulaire À Dépôt Chimique Assisté Par Plasma Rotatif Incliné (Pecvd)

Numéro d'article: KT-PE16



## Introduction

Présentation de notre four PECVD rotatif incliné pour un dépôt précis de couches minces. Profitez d'une source d'adaptation automatique, d'un contrôle de température programmable PID et d'un contrôle de débitmètre massique MFC de haute précision. Fonctions de sécurité intégrées pour une tranquillité d'esprit.

[En savoir plus](#)

Modèle de four	PE-1600-60
Max. température	1600°C
Température de travail constante	1550°C
Matériau du tube du four	Tube Al2O3 haute pureté
Diamètre du tube du four	60mm
Longueur de la zone de chauffage	2x300mm
Matériau de la chambre	Fibre d'alumine du Japon
Élément chauffant	Disiliciure de molybdène
Taux de chauffage	0-10°C/min
Couple thermique	Type B
Contrôleur de température	Contrôleur PID numérique/contrôleur PID à écran tactile
Précision du contrôle de la température	±1°C
Unité Plasma RF	
Puissance de sortie	5 -500W réglable avec ± 1% de stabilité
Fréquence RF	13,56 MHz ± 0,005 % de stabilité
Puissance de réflexion	350W max.
Correspondant à	Automatique
Bruit	
Refroidissement	Refroidissement par air.
Unité de contrôle précise du gaz	
Débitmètre	Débitmètre massique MFC
Canaux de gaz	4 canaux
Débit	MFC1 : 0-5SCCM O2 MFC2 : 0-20SCMCH4 MFC3 : 0-100 SCCM H2 MFC4 : 0-500 SCCM N2

Linéarité	±0,5 % PE
Répétabilité	±0,2 % PE
Conduite et vanne	Acier inoxydable
Pression de fonctionnement maximale	0.45MPa
Contrôleur de débitmètre	Contrôleur de bouton numérique/contrôleur d'écran tactile
Unité de vide standard (facultatif)	
Pompe à vide	Pompe à vide à palettes
Débit de la pompe	4L/S
Orifice d'aspiration sous vide	KF25
Jauge à vide	Vacuomètre silicone Pirani/Resistance
Pression de vide nominale	10 Pa
Unité de vide poussé (facultatif)	
Pompe à vide	Pompe à palettes rotatives + pompe moléculaire
Débit de la pompe	4L/S+110L/S
Orifice d'aspiration sous vide	KF25
Jauge à vide	Jauge à vide composée
Pression de vide nominale	6x10 <sup>-5</sup> Pa
Les spécifications et configurations ci-dessus peuvent être personnalisées	

Non.	Description	Quantité
1	fourneau	1
2	Tube de quartz	1
3	Bride de vide	2
4	Bloc thermique du tube	2
5	Crochet de bloc thermique de tube	1
6	Gant résistant à la chaleur	1
7	Source de plasma RF	1
8	Contrôle précis du gaz	1
9	Unité de vide	1
dix	Mode d'emploi	1